

OLYMPUS[®]

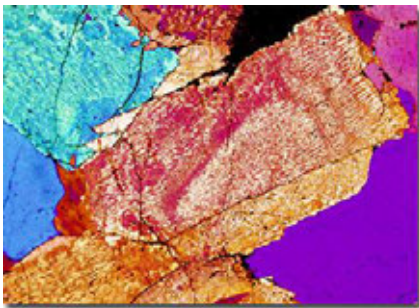
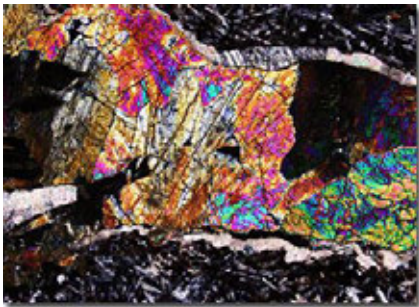
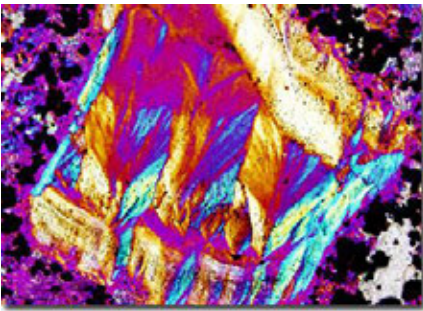
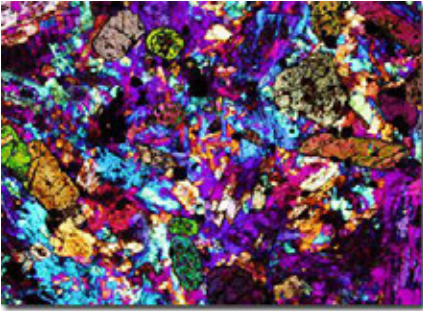
Your Vision, Our Future

BX53-P

Серия BX3M

Специализированный прямой
поляризационный оптический микроскоп
Olympus BX53-P

NEW



Комбинация поляризованного света BX53M

Оптика комбинации поляризованного света BX53M предоставляет геологам нужные инструменты для визуализации высокой контрастности поляризованным светом. Для таких областей применения, как определение минералов, изучение оптических свойств кристаллов и осмотр срезов коренных пород, полезны стабильность системы и точная оптическая регулировка.

Линза Бертрана для коноскопического и ортоскопического наблюдения

С помощью приспособления для коноскопического наблюдения U-CRA переключение между ортоскопическим и коноскопическим наблюдением происходит просто и быстро. Оно фокусируется для получения четкой интерференционной картины задней фокальной плоскости. Диафрагма поля Бертрана делает возможным получение постоянно резких и четких коноскопических изображений.



Принадлежности для поляризованного света

Оптика без внутреннего напряжения

Благодаря современной конструкции и технологии производства компании Olympus, объективы UPLFLN-P без внутреннего напряжения сокращают искажения до минимума. Это означает более высокое значение EF, что обеспечивает отличную контрастность изображения.



Объективы UPLFLN-P без внутреннего напряжения

Серия UPLFLN-P

Объективы	NA	Рабочая дистанция
UPLFLN 4XP	0,13	17,0 мм
UPLFLN 10XP	0,3	10,0 мм
UPLFLN 20XP	0,5	2,1 мм
UPLFLN 40XP	0,75	0,51 мм
UPLFLN 100XOP	1,3	0,2 мм

ПЛN-P

Объективы	NA	Рабочая дистанция
ПЛN 4XP	0,1	18,5 мм

Серия ACHN-P

Объективы	NA	Рабочая дистанция
ACHN 10XP	0,25	6,0 мм
ACHN 20XP	0,40	3,0 мм
ACHN 40XP	0,65	0,45 мм
ACHN 100XOP	1,25	0,13 мм

* Все объективы UIS2 и окуляры WHN: экостекло, которое не содержит свинца.



Ортоскопическая конфигурация BX53M

Коноскопическая/ ортоскопическая конфигурация BX53M

Широкий выбор компенсаторов и волновых пластинок

Для измерения двойного лучепреломления в тонких срезах горной породы и минералов имеются шесть разных компенсаторов. Уровень замедления измерений варьируется от 0 до 20λ. Для простоты измерений и высокой контрастности изображений можно использовать компенсаторы Берка и Сенармона, которые изменяют уровень замедления на всем поле обзора.

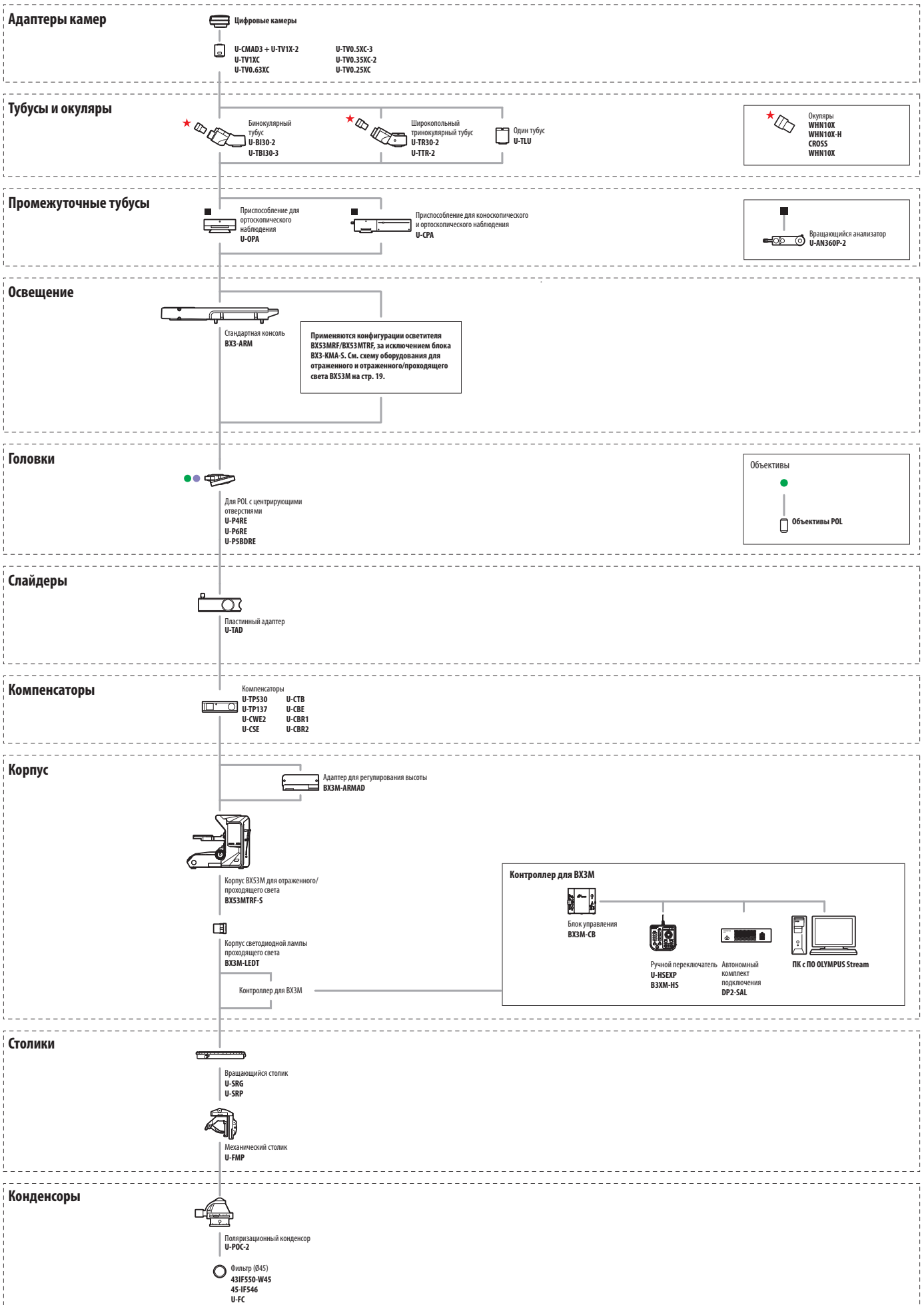


Диапазон измерений компенсаторов

Компенсатор	Диапазон измерений	Применение
Толстый, Берка (U-CSTB)	0–11 000 нм (20λ)	Измерение высокого уровня замедления ($R^* > 3λ$) (кристаллы, макромолекулы, волокно и т. п.)
Берка (U-CBE)	0–1640 нм (3λ)	Измерение уровня замедления (кристаллы, макромолекулы, живые организмы и т. п.)
Компенсатор Сенармона (U-CSE)	0–546 нм (1λ)	Измерение уровня замедления (кристаллы, живые организмы и т. п.) Повышение контрастности изображения (живые организмы и т. п.)
Компенсатор Брейса-Келера 1/10λ (U-CBR1)	0–55 нм (1/10λ)	Измерение низкого уровня замедления (живые организмы и т. п.)
Компенсатор Брейса-Келера 1/30λ (U-CBE2)	0–20 нм (1/30λ)	Измерение контрастности изображения (живые организмы и т. п.)
Кварцевый клин (U-CWE2)	500–2200 нм (4λ)	Приближенное измерение уровня замедления (кристаллы, макромолекулы и т. п.)

*R = уровень измерения
Для более точных измерений рекомендуется использовать компенсаторы (кроме U-CWE2) с интерференционным фильтром 45-IF546.

Схема оборудования VX53M (для наблюдения в поляризованном свете)



Технические характеристики BX53M (для комбинации отраженного и отраженного/проходящего света)

		BX53MTRF-S	BX53MRF-S	BXFM
Оптическая система		Оптическая система UIS2 (с бесконечной функцией коррекции)		
Корпус микроскопа	Освещение	Отраженный/проходящий	Отраженный	
	Фокус	Ход: 25 мм Точная величина хода за один оборот: 100 мкм Минимальная градуировка: 1 мкм С ограничителем верхнего предела, регулировкой вращающего момента для рукоятки грубой настройки		Ход: 30 мм Точная величина хода за один оборот: 200 мкм Минимальная градуировка: 2 мкм С регулировкой вращающего момента для рукоятки грубой настройки
	Макс. высота образца	35 мм (без прокладки) 75 мм (с BX3M-ARMAD)	65 мм (без прокладки) 105 мм (с BX3M-ARMAD)	Зависит от конфигурации размещения
Тубус для наблюдений	Широкопольный FN 22	Инвертированный: бинокулярный, тринокулярный, бинокулярный с наклоном Прямой: тринокулярный, бинокулярный с наклоном		
	Сверхширокопольный FN 26,5	Инвертированный: тринокулярный Прямой: тринокулярный, тринокулярный с наклоном		
Освещение отраженным светом	Традиционная методика наблюдения	BX3M-RLAS-S Кодированный белый светодиод, BF/DF/DIC/POL/MIX FS, AS (с центрирующим устройством), взаимоблокировка BF/DF BX3M-KMA-S Белый светодиод, BF/DIC/POL/MIX FS, AS (с центрирующим устройством), взаимоблокировка BF/DF BX3M-RLA-S Галогеновая лампа мощностью 100/50 Вт, белый светодиод, BF/DF/DIC/POL/MIX/ FS, AS (с центрирующим устройством), взаимоблокировка BF/DF, фильтр ND		U-KMAS Белый светодиод, галоген мощностью 100 Вт Волоконное освещение, BF/DIC/POL/MIX
	Флуоресценция	BX3M-URAS-S Кодированная ртутная лампа мощностью 100 Вт, 4-позиционная турель модуля зеркал (стандарт: WB, WG, WU+BF и т. д.) С FS, AS (с центрирующим устройством) с механизмом затвора		
Проходящий свет		Белый светодиод Конденсоры Аббе/с большим рабочим расстоянием	—	
Револьверная головка	Для BF	Шестикратная, центрирующая шестикратная, семикратная, кодированная пятикратная (дополнительные механические револьверные головки)		
	Для BF/DF	Шестикратная, пятикратная, центрирующая пятикратная, кодированная пятикратная (дополнительные механические револьверные головки)		
Столик (X × Y)		Столик с левой (правой) коаксиальной рукояткой: 76 мм × 52 мм, с регулировкой вращающего момента Большой столик с левой (правой) коаксиальной рукояткой: 100 мм × 105 мм, с механизмом блокировки по оси Y Большой столик с правой коаксиальной рукояткой: 50 мм × 100 мм, с регулировкой вращающего момента и механизмом блокировки по оси Y		—
Масса		Прибл. 18,3 кг (корпус микроскопа 7,6 кг)	Прибл. 15,8 кг (корпус микроскопа 7,4 кг)	Прибл. 11,1 кг (корпус микроскопа 1,9 кг)

Технические характеристики BX53M (для наблюдений в ИК)

		BX53MRF-S	BXFM
Тубус для наблюдений в ИК	Широкопольный FN 22	Инвертированный: тринокулярный	
Освещение отраженным светом	Наблюдение в ИК	BX3M-RLA-S Галогеновая лампа мощностью 100/50 Вт для ИК, BF/ИК, AS (с центрирующим устройством) с полосовым фильтром (1100, 1200 нм) BX3M-URAS-S Галогеновая лампа мощностью 100/50 Вт для ИК, BF/ИК, AS (с центрирующим устройством) с полосовым фильтром (1100, 1200 нм) и механизмом затвора	
		—	U-KMAS Галоген мощностью 100/50 Вт для ИК, BF/ИК
Револьверная головка	Для BF	Шестикратная, центрирующая шестикратная, семикратная, кодированная пятикратная (дополнительные механические револьверные головки)	
Столик (X × Y)		Столик с левой (правой) коаксиальной рукояткой: 76 мм × 52 мм, с регулировкой вращающего момента Большой столик с левой (правой) коаксиальной рукояткой: 100 мм × 105 мм, с механизмом блокировки по оси Y Большой столик с правой коаксиальной рукояткой: 150 мм × 100 мм, с регулировкой вращающего момента и механизмом блокировки по оси Y	
Масса		Прибл. 18,9 кг (корпус микроскопа 7,4 кг)	Прибл. 11,6 кг (корпус микроскопа 1,9 кг)



Трехмерный измерительный лазерный микроскоп LEXT

С помощью лазерного сканирующего микроскопа Olympus LEXT легко проводить бесконтактные объемные наблюдения и измерения особенностей поверхности при разрешении в 10 нанометров.